

# SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ

## Národního centra kompetence Centrum elektronové a fotonové optiky

uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, mezi těmito smluvními stranami:

### Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 68081731

DIČ: CZ68081731

Sídlo: Královopolská 147, 612 00 Brno

Jednající: [REDACTED]

Uchazeč (dále jen jako „ÚPT“)

a

### Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

IČ: 60077344

DIČ: CZ60077344

Sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

Jednající: [REDACTED]

Další účastník č. 1 (dále jen jako „BC“)

a

### CRYTUR, spol. s r. o.

IČ: 25296558

DIČ: CZ25296558

Sídlo: Na Lukách 2283, 511 01 Turnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13937

Jednající: Dr. Jindřich Houžvička, jednatel

Další účastník č. 2 (dále jen jako „CRYTUR“)

a

### České vysoké učení technické v Praze

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 – Dejvice

Jednající: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor

Další účastník č. 3 (dále jen jako „ČVUT“)

a

**Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.**

IČ: 46971629

DIČ: CZ46971629

Sídlo: Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00 Brno, Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7300

Jednatel: RNDr. Petr Střelec, jednatel

**Další účastník č. 4 (dále jen jako „TFS“)**

a

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8

Jednatel: [redacted]

**Další účastník č. 5 (dále jen jako „FZÚ“)**

a

**Masarykova univerzita**

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Jednatel: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor

**Další účastník č. 6 (dále jen jako „MU“)**

a

**Meopta – optika, s. r. o.**

IČ: 47677023

DIČ: CZ47677023

Sídlo: Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51239

Jednatel: Alena Moore, jednatel

**Další účastník č. 7 (dále jen jako „MEOPTA“)**

a

**MESING, spol. s r. o.**

IČ: 25579835

DIČ: CZ25579835

Sídlo: Šámalova 1537/60a, 615 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35307

Jednatel: Ing. Richard Wíttek, jednatel

**Další účastník č. 8 (dále jen jako „MESING“)**

a

**Univerzita Palackého v Olomouci**

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

Sídlo: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

Jednající: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor

**Další účastník č. 9** (dále jen jako „UPOL“)

a

**Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.**

IČ: 67985882

DIČ: CZ67985882

Sídlo: Chaberská 1014/57, 182 00, Praha 8

Jednající:

**Další účastník č. 10** (dále jen jako „ÚFE“)

a

**Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.**

IČ: 61389021

DIČ: CZ61389021

Sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha

Jednající:

**Další účastník č. 11** (dále jen jako „ÚFP“)

a

**Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.**

IČ: 61389013

DIČ: CZ61389013

Sídlo: Heyrovského náměstí 1888/2, 162 00 Praha 6

Jednající:

**Další účastník č. 12** (dále jen jako „ÚMCH“)

a

**Vysoké učení technické v Brně**

IČ: 00216305

DIČ: CZ00216305

Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Jednající:

na základě plné moci

**Další účastník č. 13** (dále jen jako „VUT“)

všichni dohromady jako „smluvní strany“ nebo „členové konsorcia“

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva upravuje ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění, využití výsledků výzkumu vytvořených v rámci Národního centra kompetence s názvem Centrum elektronové a fotonové optiky, s identifikačním číslem TN01000008, podpořeného Technologickou agenturou České republiky ve veřejné soutěži Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací národní centra kompetence.
- 1.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že výsledky projektu by měly být využity nejpozději do 5 let od ukončení projektu. V souladu s čl. 15 Všeobecných podmínek projektu je po uplynutí této doby hlavní příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití výsledků za nediskriminujících podmínek všem zájemcům.

## 2. Výsledky, vlastnická a užívací práva

- 2.1. Přehled výsledků projektu je uveden v Příloze č. 1. Výsledky jsou plně v souladu s cíli projektu.
- 2.2. Rozdělení práv k výsledkům a jejich využití, včetně práv k duševnímu vlastnictví upravuje Smlouva o založení Národního centra kompetence ze dne 31. 5. 2018 (dále jen „Smlouva NCK“) v čl. 10 a v čl. 11.
- 2.3. V souladu s čl. 10 Smlouvy NCK jsou vlastnická práva k jednotlivým výsledkům uvedena v Příloze č. 1 včetně velikosti spoluvlastnických podílů u výsledků, které jsou ve spoluvlastnictví více stran.
- 2.4. Právní ochranu výsledků, včetně úpravy právních vztahů s původci a případné úhrady nákladů na registraci a registrační i udržovací poplatky jsou smluvní strany povinny zajistit v souladu s čl. 11 Smlouvy NCK.
- 2.5. Poskytnutí majetkových práv k výsledkům ve spoluvlastnictví třetí straně je při dodržení zásad mlčenlivosti formulovaných v čl. 14 Smlouvy NCK možné jen se souhlasem všech spoluvlastníků předmětného výsledku. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě upravit vzájemná práva a povinnosti zvláštní smlouvou uzavřenou nejméně 30 dní před poskytnutím majetkových práv k výsledku třetí straně. V případě převodu majetkových práv k výsledkům mezi spoluvlastníky se souhlas ostatních spoluvlastníků nevyžaduje.
- 2.6. Každá ze smluvních stran je jako spoluvlastník předmětného výsledku oprávněna předmětný výsledek užívat pro vlastní potřebu, nebrání-li takovému užívání podmínky zák. č. 130/2002 Sb., Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a pravidla Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Smluvní strany mohou předmětný výsledek, který spoluvlastní, užívat komerčně i nekomerčně. V případě komerčního využití výsledků jednou ze smluvních stran spoluvlastnicích předmětný výsledek náleží dalším smluvním stranám spoluvlastnicím předmětný výsledek odpovídající kompenzace v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Výše odměny, včetně způsobu vyúčtování příjmů z využití společně vlastněného výsledku, bude stvrzena smlouvou mezi spoluvlastníky předmětného výsledku. Tuto smlouvu musí spoluvlastníci uzavřít před využitím společného výsledku.
- 2.7. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o zájmu třetích stran o využití výsledků. Poskytnutí licence ve spoluvlastnictví třetí straně je možné po odsouhlasení všemi spoluvlastníky a za podmínky poskytnutí úplaty třetí stranou minimálně ve výši odpovídající jejich tržní ceně. Smluvní strany, které spoluvlastní předmětný výsledek, jsou povinny v takovém případě upravit vzájemná práva a povinnosti zvláštní smlouvou, uzavřenou nejméně 30 dní před poskytnutím licence třetí straně.

## 3. Omezení odpovědnosti

- 3.1. Žádná ze smluvních stran nenesou odpovědnost za jakékoliv použití výsledků projektu dalšími smluvními stranami a za případné škody tím způsobené v maximálně možném rozsahu takového omezení odpovědnosti, které dovolují platné právní předpisy.



#### 4. Náhrada škody a sankce

- 4.1. Smluvní strana, která poruší tuto smlouvu, nahradí dalším smluvním stranám způsobenou újmu.
- 4.2. V případě neuzavření smlouvy se spoluvlastníky podle ustanovení odst. 2.5, odst. 2.6 nebo odst. 2.7 je každá smluvní strana, která závazek neporušila, oprávněna vyúčtovat porušující smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé prokázané porušení uvedené povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

#### 5. Důvěrnost údajů

- 5.1. Projekt, způsob jeho řešení ani výsledky jeho řešení nejsou utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že informace, dokumentace a výsledky práce, předané a vzniklé v souvislosti s plněním projektu, mohou být pokládány za důvěrné. Informace o výsledcích projektu povinně dodávané do IS VaV, Rejstřík informací o výsledcích či dalších obdobných rejstříků, budou předány v takové podobě a míře podrobnosti, která bude respektovat ochranu důvěrných informací.
- 5.3. Ochrana důvěrných informací se netýká informací již zveřejněných ve formě publikačních výsledků projektu.

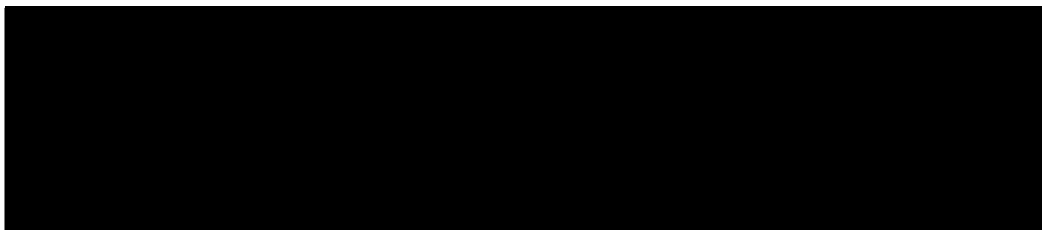
#### 6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky v této smlouvě blíže neupravené se řídí obecnými ustanoveními o spoluvlastnictví zejména dle § 1115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním anonymizované smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ÚPT. Informaci o zveřejnění zasílá všem smluvním stranám do datových schránek přímo systém Registru smluv. V té souvislosti smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství, které by bylo třeba anonymizovat nad rámec anonymizace údajů požadované zákonem.
- 6.3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 s přehledem výsledků projektu.
- 6.4. Smlouva je vyhotovena v 29 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy a jeden stejnopis obdrží Poskytovatel.
- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad.

V Brně dne 14.12.2022

.....  
[redacted]  
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  
[redacted]

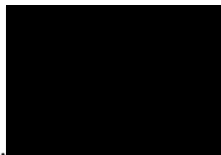
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH dne 16-12-2022



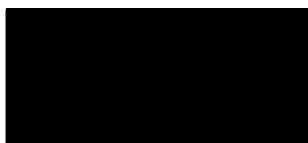
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.



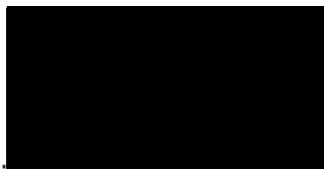
v TURNOVĚ dne 14. 12. 2022



CRYTUR, spol. s r. o.  
Dr. Jindřich Houžvička  
Jednatel



V ..... *PRAZE* ..... dne *22-12-2022* .....

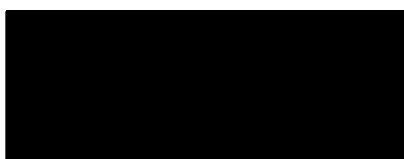


.....

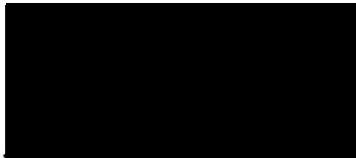
**České vysoké učení technické v Praze**

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Rektor



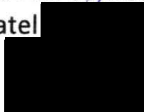
V BRNE<sup>v</sup> ..... dne 14.12.2022



.....  
**Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.**

RNDr. Petr Střelec

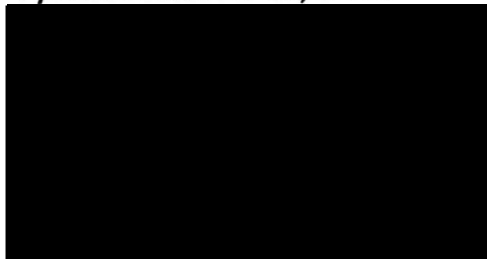
Jednatel




V Praze dne ..... 19. 12. 2022 .....

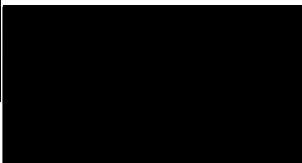
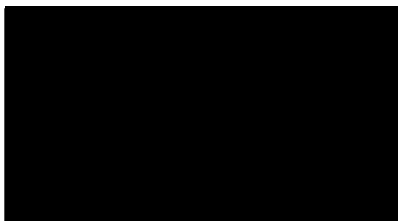


.....  
**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**



19. 12. 2022

V  BAREŠ ..... dne .....

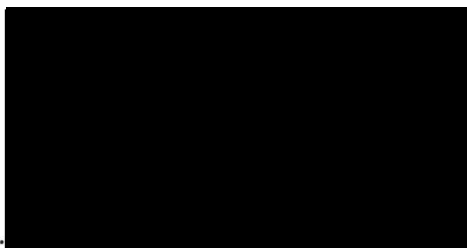


**Masarykova univerzita**  
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.  
Rektor

Přerově

15.12.2022

V ..... dne .....

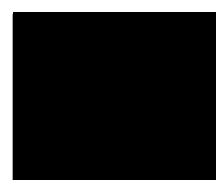


.....

**Meopta – optika, s. r. o.**

Alena Moore

Jednatel



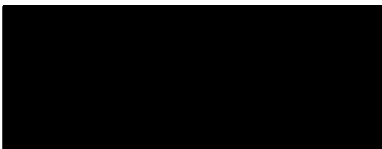


V .....<sup>BRNĚ</sup>..... dne .....<sup>14.11.2022</sup>.....



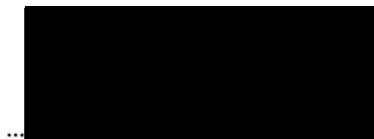
.....  
**MESING, spol. s r. o.**  
Ing. Richard Wittek  
Jednatel

V Olomouci ..... dne 20. 12. 2022 .....

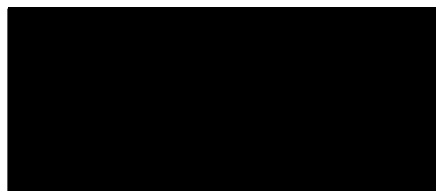
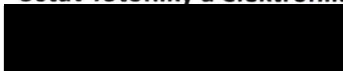


.....  
**Univerzita Palackého v Olomouci**  
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  
Rektor

V Praze ..... dne 14-12-2022



...  
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.



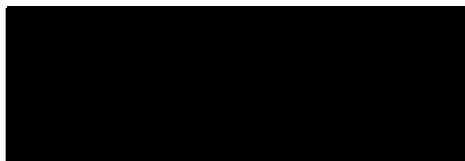
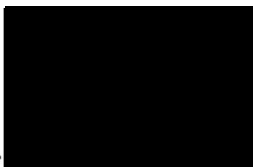
V .....*mm*..... dne ..... 16. 12. 2022



Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.



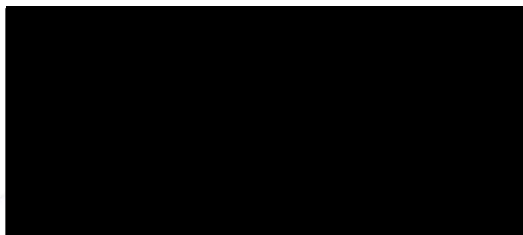
v *Praxe* ..... dne *14. 12. 2022* .....



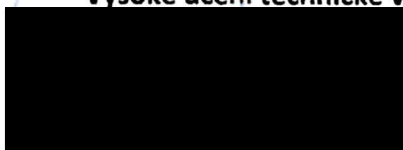
.....  
**Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.**



V Brně dne .....13.1.2023.....



Vysoké učení technické v Brně



V Brně 15. února 2022  
Čj.: 028/90110/22

## PLNÁ MOC

Vysoké učení technické v Brně se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno  
IČ 00216305, zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

zastoupené

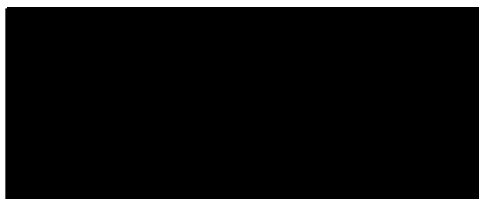
**doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M., rektorem**

**z m o c ň u j e**

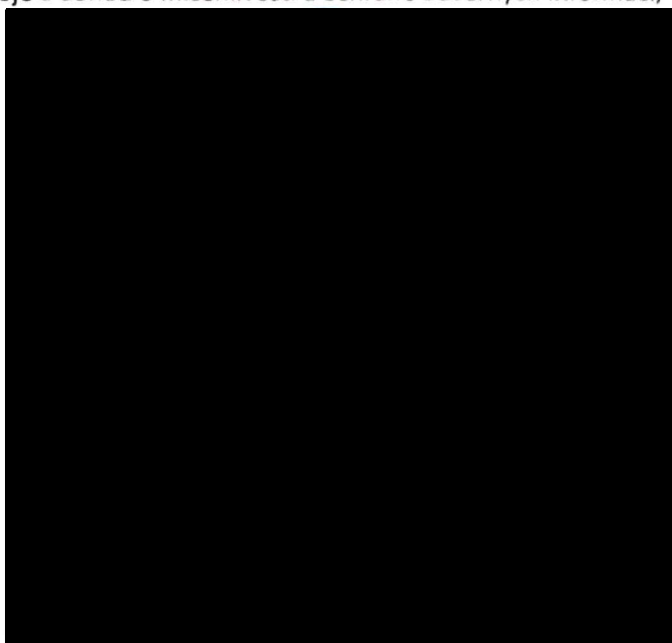


k zastupování a jednání za VUT při podpisu veškerých listin a smluv v oblasti:

- a) přihlášek vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a dalších práv průmyslového vlastnictví evidovaných u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a obdobných zápisných úřadů jiných států a regionů,
- b) všech podání spojených s těmito přihláškami a příkazních smluv pro patentové zástupce k zajištění těchto úkonů,
- c) dokumentů řešených v kompetenci Odboru transferu technologií Rektorátu VUT, zejména smluv o převodu práv na předmět průmyslového vlastnictví, smluv o poskytnutí odměny původcům za uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví, smluv o spoluvlastnictví práv duševního vlastnictví, licenčních smluv, smluv o využití výsledků výzkumu a vývoje a dohod o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací,
- d) licenčních smluv nakladatelských.



Zmocnění v plném rozsahu přijímám.



Příloha č. 1 ke Smlouvě o využití výsledků Národního centra kompetence Centrum elektronové a fotonové optiky

| DP   | TACR          | Řešitel | Označení dle TACR    | Druh výsledku | Název   | Rozdělení práv dle návrhu DP           | Plán. termín dosažení | Skutečný termín dosažení | Jaký bude vlastnický podíl na výsledku v %? |
|------|---------------|---------|----------------------|---------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---|
| DP30 | TN01000008/01 |         | TN01000008/1-V2      | Ostatní       | Annual Report on activities of the Centre Council 2020  | -                                      | 31.12.2020            | 31.12.2020               |   |
| DP30 | TN01000008/01 |         | TN01000008/1-V1      | Ostatní       | Annual Report on activities of the Centre Council 2019  | -                                      | 31.12.2019            | 31.12.2019               |   |
| DP30 | TN01000008/01 |         | TN01000008/1-V3      | Ostatní       | Annual Report on activities of the Centre Council 2021  |  | 31.12.2021            | 31.12.2021               |   |
| DP30 | TN01000008/01 |         | TN01000008/01 -V0004 | Ostatní       | Annual Report on activities of the Centre Council 2022  |  | 31.12.2022            |                          |   |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V6      | Ostatní       | Scientific publication  | 100% ÚFP                               | 28.02.2020            | 30.12.2019               | 100% ÚFP                                    |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V3      | Gfunk         | Contact tool functional sample  | 60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT            | 28.02.2020            | 28.02.2020               | 60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT                 |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V1      | Ztech         | Verified technology of the 3D correction by contact tool  | 45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT           | 31.12.2020            | 21.12.2020               | 45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT                |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V4      | Gfunk         | Noncontact tool functional sample   | 60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT            | 31.12.2020            | 27.10.2020               | 60% ÚFP, 35% Crytur, 5% ÚPT                 |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V7      | Ostatní       | Scientific publication  | 100% ÚFP                               | 31.12.2020            | 19.11.2020               | 100% ÚFP                                    |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V2      | Ztech         | Verified technology of the 3D correction by noncontact tool   | 45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT           | 31.12.2020            | 23.12.2020               | 45% ÚFP, 45% Crytur, 10% ÚPT                |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V5      | Ostatní       | Methodology for the characterization of the laser rod shape by multi-wave interferometry                              | ÚFP 80%, ÚPT 5%, CRYTUR 10%, Meopta 5% | 30.09.2019            | 30.09.2019               | ÚFP 80%, ISI 5%, CRYTUR 10%, Meopta 5%      |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V8      | Ztech         | Verified technology for 3D correction of laser rod faces with minimized micro-roughness                               | 70% ÚFP, 25% Crytur, 5% ÚPT            | 31.12.2021            | 22.12.2021               | 70% ÚFP, 25% Crytur, 5% ÚPT                 |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/2-V9      | Gfunk         | Functional sample of a non-contact correction tool based on focused IBF   | 60% ÚFP, 10% Crytur, 30% ÚPT           | 31.12.2021            | 14.12.2021               | 60% ÚFP, 10% Crytur, 30% ÚPT                |
| DP08 | TN01000008/02 |         | TN01000008/02 -V010  | Gfunk         | Functional sample of multi wave length interferometer for laser rods characterization                                 | ÚFP 85 %, ÚPT 5 %, Crytur 10 %         | 31.12.2022            |                          | ÚFP 85 %, ÚPT 5 %, Crytur 10 %              |
| DP05 | TN01000008/03 |         | TN01000008/3-V3      | Gfunk         | Production optics with beam transformation  | MEOPTA 100%                            | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 100% Meopta                                 |
| DP05 | TN01000008/03 |         | TN01000008/3-V4      | Gfunk         | Tunable Fiber Laser   | 100% ÚFE                               | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 100% ÚFE                                    |
| DP05 | TN01000008/03 |         | TN01000008/03-V1     | Ztech         | Advanced laser processing by beam profile transformation  | FZU Hlase 50%, MEOPTA 50%              | 31.12.2020            | 31.12.2020               | FZU Hlase 50%, MEOPTA 50%                   |
| DP05 | TN01000008/03 |         | TN01000008/03-V2     | Ztech         | Laser processing of carbides  | ÚPT 100%                               | 31.12.2020            | 31.12.2020               | ÚPT 100%                                    |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/4-V3      | Gfunk         | Phantom for 3D resolution   | TFS 70%, VUT 30%                       | 31.12.2020            | 02.10.2019               | VUT 30%, TFS 70%                            |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/4-V1      | Ostatní       | Error measurement accuracy methodology  | TFS 30%, VUT 70%                       | 31.12.2020            | 22.12.2020               | VUT 70%, TFS 30%                            |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/4-V4      | Ostatní       | Conference Abstract   | TFS 70%, VUT 30%                       | 31.12.2020            | 09.09.2020               | VUT 40%, UMCH 30%, TFS 30%                  |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/4-V2      | R software    | Measuring 3D resolution algorithm (software)  | TFS 50%, VUT 50%                       | 31.12.2020            | 22.12.2020               | VUT 50%, TFS 50%                            |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/4-V5      | Gfunk         | Helical scanning sample holder  | TFS 70%, VUT 30%                       | 31.12.2021            | 15.11.2021               | TFS 70%, VUT 30%                            |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/04-V006   | Fuzit         | Sub-micron precision phantom  | VUT 100 %                              | 31.12.2022            |                          | NEDOSAŽEN<br>VUT 30%, TFS 70%               |
| DP14 | TN01000008/04 |         | TN01000008/04-V007   | Gfunk         | Life science sample holder  | VUT 100 %                              | 31.12.2022            |                          | VUT 100 %                                   |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V2      | Gfunk         | Special photomask for image distortion measurement of projection optics   | MEOPTA 50%, ÚPT 50%                    | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 50% Meopta, 50% ÚPT                         |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V4      | Gfunk         | Optimal DMD wavefront sensor for optical systems assembly   | UPOL 40%, MEOPTA 60%                   | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 60% Meopta, 40% UPOL                        |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V5      | Gfunk         | Testing bench for transmission wavefront measurement of optical elements  | MUNI-CEITEC 100%                       | 31.12.2020            | 31.12.2020               | MUNI-CEITEC 100%                            |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V3      | Ostatní       | Optimal detection schemes of lithographic lens parameters   | UPOL 80%, MEOPTA 20%                   | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 80% UPOL, 20% MEOPTA                        |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V6      | Ostatní       | Holographic microscopy of levitating particles  | ÚPT 100%                               | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 100% ÚPT                                    |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V1      | Ztech         | Wavefront measurement of projection lithography optics by intensity scans   | UPOL 10%, MEOPTA 90%                   | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 90% Meopta, 10% UPOL                        |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V7      | Gfunk         | Wavefront sensor based on Phase Retrieval   | Meopta 100%                            | 31.12.2021            | 31.12.2021               | Meopta 100%                                 |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V8      | Gfunk         | Special photomask for wavefront measurement of projection optics  | Meopta 50%, ÚPT 50%                    | 31.12.2021            | 31.12.2021               | Meopta 40%, ÚPT 40%, UPOL 20%               |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V9      | Ostatní       | Digital holography for lithographic lens wavefront measurement.   | Meopta 10%, ÚPT 90%                    | 31.12.2021            | 31.12.2021               | Meopta 10%, ÚPT 90%                         |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V10     | Ostatní       | Optimal detection schemes for the wavefront and distortion metrology  | UPOL 80%, Meopta 20%                   | 31.12.2021            | 31.12.2021               | UPOL 80%, Meopta 20%                        |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V11     | Gfunk         | DMD wavefront sensor for laser beam characterization  | UPOL 40%, Meopta 60%                   | 31.12.2021            | 31.12.2021               | UPOL 40%, Meopta 60%                        |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V12     | Ostatní       | Glass mask with sub-micron pinholes.  | ÚPT 100%                               | 31.12.2021            | 31.12.2021               | ÚPT 100%                                    |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/5-V13     | Gfunk         | Functional sample of testing bench for high-speed sensing of the direction of reflected light.                        | VUT 100%                               | 31.12.2021            | 31.12.2021               | VUT 100%                                    |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/05-V014   | Ostatní       | Fast characterization of image from holographic microscopy.   | ÚPT 100 %                              | 31.12.2022            |                          | ÚPT 100 %                                   |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/05-V015   | Gfunk         | Opto-mechanical assembly using DMD for sample scanning in confocal imaging mode                                       | VUT-CEITEC 100 %                       | 31.12.2022            |                          | VUT-CEITEC 100 %                            |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/05-V016   | Gfunk         | DMD wavefront sensor for microscope objective testing   | Meopta 100 %                           | 31.12.2022            |                          | Meopta 100 %                                |
| DP09 | TN01000008/05 |         | TN01000008/05-V017   | Ostatní       | SLM generated Laguerre-Gaussian beams for axial localization  | MEOPTA 100 %                           | 31.12.2022            |                          | UPOL 100%                                   |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V1      | Gfunk         | Adjustable stress-free mounting system  | MEOPTA 75%, ČVUT 25%                   | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 75 % Meopta, 25% ČVUT                       |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V3      | Gfunk         | Turning centering head  | MEOPTA 70%, ČVUT 30%                   | 31.12.2020            | 31.12.2020               | MEOPTA 70%, ČVUT 30%                        |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V5      | Gfunk         | Active vibration suppression of optical devices   | MEOPTA 70%, ČVUT 30%                   | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 70 % Meopta, 30 % ČVUT                      |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V2      | Ztech         | Adjustable stress-free mounting system  | 100 % Meopta                           | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 100 % Meopta                                |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V4      | Ztech         | Turning centering head in the production  | 100 % Meopta                           | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 100 % Meopta                                |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V6      | Ztech         | Production and Measurement of Conical Ring  | MEOPTA 75%, ČVUT 25%                   | 31.12.2021            | 31.12.2021               | MEOPTA 75%, ČVUT 25%                        |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V7      | Ztech         | Adaptive control system for active absorption implemented on the low-cost control hardware platform.                  | MEOPTA 60%, ČVUT 40%                   | 31.12.2021            | 31.12.2021               | MEOPTA 60%, ČVUT 40%                        |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V8      | Ostatní       | Methodology for composite/hybrid structures optimizing by FEM   | MEOPTA 80%, ČVUT 20%                   | 31.12.2021            | 31.12.2021               | MEOPTA 80%, ČVUT 20%                        |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/6-V9      | Gfunk         | Optical Clamp Mount   | MEOPTA 80%, ČVUT 20%                   | 31.12.2021            | 31.12.2021               | MEOPTA 80%, ČVUT 20%                        |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/06-V009   | Gfunk         | Concept based on the principle of automated air bearing   | Meopta 80 %, ČVUT 20 %                 | 31.12.2022            |                          | Meopta 80 %, ČVUT 20 %                      |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/06-V010   | Gfunk         | Active dynamic absorber with low passive resistances  | Meopta 40 %, ČVUT 60 %                 | 31.12.2022            |                          | Meopta 40 %, ČVUT 60 %                      |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/06-V011   | Ostatní       | Functional analysis of optical mount  | Meopta 50 %, ČVUT 50 %                 | 31.12.2022            |                          | Meopta 50 %, ČVUT 50 %                      |
| DP01 | TN01000008/06 |         | TN01000008/06-V012   | Ostatní       | Analysis of optomechanical design of microscope objective lenses  | Meopta 20 %, ČVUT 80 %                 | 31.12.2022            |                          | Meopta 20 %, ČVUT 80 %                      |
| DP03 | TN01000008/07 |         | TN01000008/7-V2      | Ztech         | TRL7 Perla C 100W   | FZÚ (Hlase) 100%                       | 31.12.2020            | 31.12.2020               | 100% FZÚ (Hlase)                            |
| DP03 | TN01000008/07 |         | TN01000008/7-V1      | Ztech         | Surface structuring of dielectric materials   | Crytur 100%                            | 31.12.2020            | 31.12.2020               | Crytur 100%                                 |
| DP03 | TN01000008/07 |         | TN01000008/7-V3      | Gfunk         | Single crystal phosphor component for laser based lighting  | Crytur 100%                            | 31.12.2021            | 20.09.2021               | Crytur 100%                                 |
| DP03 | TN01000008/07 |         | TN01000008/7-V4      | Gfunk         | Optical substrates with laser engraving   | FZÚ (Hlase) 60%, Crytur 40%            | 31.12.2021            | 15.11.2021               | FZÚ (Hlase) 60%, Crytur 40%                 |
| DP03 | TN01000008/07 |         | TN01000008/7-V5      | Gfunk         | Imaging screen of nonsymmetric shape  | Crytur 100%                            | 30.09.2021            | 22.09.2021               | Crytur 100%                                 |
| DP03 | TN01000008/07 |         | TN01000008/07-V006   | Gfunk         | Cr-YAG solid state light source for Yb-YAG laser extension to 1.48 um   | FZÚ (Hlase) 67%, Crytur 33%            | 31.12.2022            |                          | FZÚ (Hlase) 67%, Crytur 33%                 |
| DP25 | TN01000008/08 |         | TN01000008/8-V4      | Gfunk         | Apparatus for semi-automated etching of metallographic samples  | ÚPT 100%                               | 31.12.2020            | 30.10.2020               | ÚPT 100%                                    |
| DP25 | TN01000008/08 |         | TN01000008/8-V1      | Ostatní       | Publication - Advanced methods of TRIP steel sample preparation and imaging using modern scanning electron microscopy | ÚPT 100%                               | 31.12.2020            | 12.11.2019               | ÚPT 100%                                    |
| DP25 | TN01000008/08 |         | TN01000008/8-V2      | Ostatní       | Publication - Contribution of modern scanning electron microscopy for the study of steels                             | ÚPT 100%                               | 31.12.2020            | 01.06.2020               | ÚPT 100%                                    |



|      |               |                    |            |   |   |            |            |   |
|------|---------------|--------------------|------------|---|---|------------|------------|---|
| DP25 | TN01000008/08 | TN01000008/8-V3    | Ostatni    | Publication - Effect of native oxide on reflectivity of slow and super slow electrons from mild steel surface | ÚPT 100%  | 31.12.2020 | 01.08.2020 | ÚPT 100%                                |
| DP25 | TN01000008/08 | TN01000008/8-V5    | Gfunk      | Method and apparatus for automated electropolishing process   | ÚPT 100%  | 31.12.2021 | 30.10.2021 | ÚPT 100%                                |
| DP25 | TN01000008/08 | TN01000008/8-V6    | Ostatni    | Publications  | ÚPT 100%  | 31.12.2021 | 18.05.2021 | ÚPT 100%                                |
| DP25 | TN01000008/08 | TN01000008/08-V007 | Ostatni    | Scientific paper  | ÚPT 100%  | 31.12.2022 |            | ÚPT 100%                                |
| DP25 | TN01000008/08 | TN01000008/08-V008 | Ostatni    | Scientific paper  | ÚPT 100%  | 31.12.2022 |            | ÚPT 100%                                |
| DP06 | TN01000008/09 | TN01000008/9-V2    | Gfunk      | An optical element that transmits light from a thin transparent pad   | ÚPT 90%, Crytur 10%   | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 90% ÚPT, 10% Crytur                     |
| DP06 | TN01000008/09 | TN01000008/9-V1    | Fuzit      | Telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications                                      | MEOPTA 100%   | 31.12.2020 | 30.11.2020 | Meopta 100%                             |
| DP06 | TN01000008/09 | TN01000008/9-V4    | Gfunk      | Objective with variable focal spot for LIDT   | ÚPT 10%, ÚFP 90%  | 30.6.2021  | 30.10.2021 | ÚPT 10%, ÚFP 90%                        |
| DP06 | TN01000008/09 | TN01000008/9-V3    | Gfunk      | Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm                | ÚPT 50%, MEOPTA 50%   | 30.11.2022 |            | ÚPT 50%, MEOPTA 50%                     |
| DP06 | TN01000008/09 | TN01000008/9-V005  | Gfunk      | Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm                | ÚPT 50 %, Meopta 50 %   | 31.11.2022 |            | ÚPT 50 %, Meopta 50 %                   |
| DP24 | TN01000008/10 | TN01000008/10-V1   | Ostatni    | An approach to magnetic contrast imaging on bulk and nanoscale domains by shaped beams                        | ÚPT 100%  | 31.12.2020 | 01.10.2020 | ÚPT 100%                                |
| DP24 | TN01000008/10 | TN01000008/10-V2   | Ostatni    | Implementation of vortex beams into an SEM  | ÚPT 100%  | 31.12.2020 | 01.06.2020 | ÚPT 100%                                |
| DP24 | TN01000008/10 | TN01000008/10-V3   | Ostatni    | Real-time imaging of nanoscale phenomena in SEM   | VUT-CEITEC 100%   | 31.12.2020 | 01.07.2020 | VUT-CEITEC 100%                         |
| DP24 | TN01000008/10 | TN01000008/10-V4   | Gfunk      | Calibration sample for magnetic contrast imaging in SEM   | VUT-CEITEC 80%, TFS 20%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | VUT-CEITEC 80%, TFS 20%                 |
| DP24 | TN01000008/10 | TN01000008/10-005  | Gfunk      | Nanoscale calibration sample for magnetic contrast imaging in SEM   | VUT-CEITEC 50 %, TFS 50 %   | 31.12.2022 |            | VUT-CEITEC 50 %, TFS 50 %               |
| DP24 | TN01000008/10 | TN01000008/10-006  | Gfunk      | Aperture holder for silicon nitride membranes   | ÚPT 100 %   | 31.12.2022 |            | ÚPT 100 %                               |
| DP07 | TN01000008/11 | TN01000008/11-V2   | Gfunk      | Fabrication and optimization of dielectric plasmonic metalenses   | VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%  | 31.12.2020 | 19.11.2020 | VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %          |
| DP07 | TN01000008/11 | TN01000008/11-V3   | Ostatni    | Geometric-Phase Microscopy for Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces                           | VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%  | 31.12.2020 | 20.12.2020 | VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %          |
| DP07 | TN01000008/11 | TN01000008/11-V1   | Gfunk      | Fabrication and optimization of metallic plasmonic metalenses   | VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %          |
| DP07 | TN01000008/11 | TN01000008/11-V4   | Gfunk      | Polarization Manipulation Using a Dielectric Metasurface  | VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%  | 31.12.2021 | 14.12.2021 | VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %          |
| DP07 | TN01000008/11 | TN01000008/11-V005 | Gfunk      | Multifunctional optical element based on dielectric metasurface   | VUT-CEITEC 90%, Meopta 10%  | 31.12.2022 |            | VUT v Brně: 90 %, Meopta: 10 %          |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V1   | Gfunk      | Kit for sample preparation  | BC 60%, UMCH 30%, ÚPT 10%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | BC 60%, UMCH 30%, ÚPT 10%               |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V2   | Ostatni    | Publication   | BC 70%, UMCH 20%, ÚPT 10%   | 31.12.2020 | 20.12.2020 | BC 70%, UMCH 20%, ÚPT 10%               |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V3   | Ostatni    | Structure characterization and biodegradation rate of poly( $\epsilon$ -caprolactone)/starch blends.          | UMCH 100%   | 31.12.2020 | 05.06.2020 | UMCH 100%                               |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V4   | Ostatni    | research report   | BC 20%, UMCH 60%, ÚPT 20%   | 31.12.2020 | 21.12.2020 | BC 20%, UMCH 60%, ÚPT 20%               |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V5   | Ostatni    | Bio-Applicable Metal Nanoparticles  | BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%   | 31.12.2020 | 30.11.2020 | BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%               |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V6   | Ostatni    | Publication   | BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%   | 31.12.2020 | 31.12.2019 | BC 20%, UMCH 20%, ÚPT 60%               |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V7   | Fuzit      | Kit for sample preparation  | BC 90%, UMCH 8%, ÚPT 2%   | 31.12.2022 | xii.21     | 100% BC                                 |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V8   | Gfunk      | Resin for 3D SEM  | BC 10%, UMCH 85%, ÚPT 5%  | 31.12.2021 | 11/2021    | BC 10%, UMCH 85%, ÚPT 5%                |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V9   | Gfunk      | Blot-free vitrification technique   | ÚPT 5%, MUNI - CEITEC 80%, TFS 15%  | 31.12.2021 | 12/2021    | MUNI-CEITEC 100%                        |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V010 | Gfunk      | Improved specimen preparation kit for 3D SEM  | BC 85 %, UMCH 10 %, ÚPT 5 %   | 31.12.2022 |            | BC 85 %, UMCH 10 %, ÚPT 5 %             |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V011 | Gfunk      | Resin for 3D SEM with improved adhesion to bio-samples  | BC 10 %, UMCH 85 %, ÚPT 5 %   | 31.12.2022 |            | BC 10 %, UMCH 85 %, ÚPT 5 %             |
| DP27 | TN01000008/12 | TN01000008/12-V012 | Gfunk      | TEM grid temperature controller   | MUNI-CEITEC 100 %   | 31.12.2022 |            | MUNI-CEITEC 100 %                       |
| DP11 | TN01000008/13 | TN01000008/13-V3   | Gfunk      | Update of the Raman optical activity spectrometer   | UPOL 50%, Meopta 50%  | 28.02.2021 | 30.06.2021 | UPOL 50%, Meopta 50%                    |
| DP11 | TN01000008/13 | TN01000008/13-V4   | Gfunk      | Update of the Raman spectrometer for the deep UV spectral range   | UPOL 50%, Meopta 50%  | 30.04.2021 | 31.07.2021 | UPOL 50%, Meopta 50%                    |
| DP11 | TN01000008/13 | TN01000008/13-V2   | Gfunk      | Functional sample of cell compartment optimized for polarized Raman spectroscopy                              | UPOL 50%, ÚPT 50%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | UPOL 50%, ÚPT 50%                       |
| DP11 | TN01000008/13 | TN01000008/13-V5   | Gfunk      | Accessory extending Raman optical spectrometer capabilities   | UPOL 40%, Meopta 40%, ÚPT 20%   | 30.04.2022 |            | UPOL 40%, Meopta 40%, ÚPT 20%           |
| DP11 | TN01000008/13 | TN01000008/13-V006 | Gfunk      | Functional sample for calibration of phase retardation  | UPOL 50 %, Meopta 50 %  | 31.12.2022 |            | UPOL 50 %, Meopta 50 %                  |
| DP11 | TN01000008/13 | TN01000008/13-V007 | Gfunk      | Functional sample of motorized positioning cell with temperature control for ROA spectrometer                 | UPOL 50 %, ÚPT 50 %   | 31.12.2022 |            | UPOL 50 %, ÚPT 50 %                     |
| DP23 | TN01000008/14 | TN01000008/14-V1   | Gfunk      | Advanced hydration system for ESEM  | ÚPT 100%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 100%                                |
| DP23 | TN01000008/14 | TN01000008/14-V002 | Ostatni    | Advanced hydration system for ESEM  | IS-100%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 100%                                |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V3   | Gfunk      | Functional sample of setup for 3 axis alignment   | MEOPTA 50%, ÚFP 50%   | 31.05.2020 | 31.12.2020 | 50% Meopta, 50% ÚFP                     |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V2   | Ostatni    | Alignment strategies for diffraction limited optics   | MEOPTA 50%, CVUT 50%  | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 50% Meopta, 50% CVUT                    |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V4   | Ostatni    | Placing the optics into the mechanical parts  | MEOPTA 50%, VUT CEITEC 50%  | 30.06.2020 | 31.05.2020 | 50% Meopta, 50% ÚFP                     |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V1   | Gfunk      | Alignment testing sample  | MEOPTA 20%, CVUT 80%  | 31.12.2020 | 30.06.2020 | 20% Meopta, 80% CVUT                    |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V5   | Ztech      | Automised alignment of optomechanical system based on advanced detection, algorithms and mechatronics         | MEOPTA 70%, ÚFP 30%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | MEOPTA 70%, ÚFP 30%                     |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V6   | Ostatni    | Analysis of physical methods for centering of optical elements and systems                                    | MEOPTA 20%, CTU 80%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | MEOPTA 20%, CTU 80%                     |
| DP04 | TN01000008/15 | TN01000008/15-V7   | Ostatni    | Design of components for advanced adjustment of opto-mechanical systems.                                      | MEOPTA 10%, VUT 90%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | MEOPTA 10%, VUT 90%                     |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V1   | Gfunk      | Annular aperture for SEM  | ÚPT 50%, TFS 50%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 50% ÚPT, 50% TFS                        |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V2   | Gfunk      | Objective lens extender   | ÚPT 40%, TFS 60%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 40%, TFS 60%                        |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V4   | Ostatni    | Annular aperture for SEM  | ÚPT 70%, TFS 30%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 70%, TFS 30%                        |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V5   | Ostatni    | Variable objective lens   | ÚPT 70%, TFS 30%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 70%, TFS 30%                        |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V3   | R software | DFProbe   | ÚPT 100%  | 31.12.2019 | 31.12.2019 | ÚPT 100%                                |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V6   | Gfunk      | Extender for NiCOI column with deflectors   | ÚPT 50%, TFS 50%  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 50%, TFS 50%                        |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V7   | Gfunk      | Graphene Foil Lens Corrector  | ÚPT 10%, TFS 90%  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 10%, TFS 90%                        |
| DP16 | TN01000008/16 | TN01000008/16-V008 | Gfunk      | Graphene Foil Lens Corrector  | ÚPT 10 %, TFS 90 %  | 31.12.2022 |            | ÚPT 10 %, TFS 90 %                      |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V1   | Gfunk      | New phase plate for TEM modifying beam phase  | ÚPT 40%, TFS 60%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 40%, TFS 60%                        |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V2   | Ostatni    | HR-STEM optimizing algorithm for Cs non-corrected TEM   | ÚPT 50%, TFS 50%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 50%, TFS 50%                        |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V3   | Ostatni    | Development and testing of phase plates   | ÚPT 60%, TFS 20%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 60%, TFS 40%                        |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V4   | Ostatni    | HR-STEM imaging optimization  | ÚPT 60%, TFS 40%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 60%, TFS 40%                        |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V5   | Ostatni    | Phase plates preparation technologies   | ÚPT 80%, TFS 20%  | 30.09.2019 | 30.09.2019 | ÚPT 80%, TFS 20%                        |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V6   | Gfunk      | Si3Nx phase plates  | ÚPT 50%, TFS 50%  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 50%, TFS 50%                        |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V7   | Gfunk      | Phase plates holder for the cleaning procedures   | ÚPT 100%  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 100%                                |
| DP17 | TN01000008/17 | TN01000008/17-V008 | Gfunk      | Si3Nx phase plates covered by conductive layer  | ÚPT 50 %, TFS 50 %  | 31.12.2022 |            | ÚPT 50 %, TFS 50 %                      |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V1   | Gfunk      | Optical assembly with high-finesse resonator for frequency stabilization of highly-coherent lasers            | ÚPT 55%, BUT SIX 5%, UPOL 5%, IPE 10%, ÚFP 15%, MEOPTA 5%, MESING 5%      | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 40%, ÚFP 50%, MEOPTA 5%, MESING 5%  |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V2   | Gfunk      | Lens for collecting fluorescence from cold quantum objects  | ÚPT 15%, BUT SIX 0%, UPOL 60%, IPE 0%, ÚFP 20%, MEOPTA 5%, MESING 0%      | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 10%, UPOL 60%, MEOPTA 30%           |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V3   | Gfunk      | Optical assembly of Free Space Optics communication unit  | ÚPT 10%, BUT SIX 60%, UPOL 0%, IPE 0%, ÚFP 20%, MEOPTA 10%, MESING 0%     | 31.12.2020 | 20.12.2020 | ÚPT 10%, BUT SIX 60%, ÚFP 5%, MEOPTA 5% |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V5   | Ostatni    | Laser source for high resolution spectroscopy   | ÚPT 5 %, BUT SIX 0 %, UPOL 0 %, IPE 95 %, ÚFP 0 %, MEOPTA 0 %, MESING 0 % | 30.04.2021 | 31.05.2021 | ÚPE 100%                                |

|      |               |                    |            |  |  |            |            |  |
|------|---------------|--------------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V6   | Ostatni    | Procedures for very fine optical components manufacturing and assembling                                     | ÚPT 0%, BUT SIX 0%, UPOL 0%, IPE 0%, ÚFP 80%, MEOPTA 20%, MESING 0%  | 31.03.2021 | 30.04.2021 | ÚFP 90%, UPT 10%   |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V7   | Ostatni    | Optical frequency references based on microstructured photonic fibres and their use in frequency controlled  | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 100%   |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V4   | Ztech      | Technology to adjust very precise optical standards, cavities and lenses                                     | ÚPT 10%, BUT SIX 5%, UPOL 5%, IPE 0%, ÚFP 70%, MEOPTA 10%, MESING 0% | 31.12.2020 | 21.12.2020 | ÚPT 5%, ÚFP 90%, MEOPTA 5%                                     |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V8   | Ztech      | Proven technology for processing complex optical elements of extremely hard materials                        | ÚPT 20%, ÚFP 80%   | 31.12.2020 | 30.12.2020 | ÚPT 5%, ÚFP 95%  |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V9   | Gfunkt     | Paul-type electric trap for trapping charged atomic and molecular ions                                       | ÚPT 60%, UPOL 20%, ÚFP 20%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 60%, UPOL 30%, MESING 10%                                  |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V10  | Gfunkt     | The highly-coherent source of optical frequency  | ÚPT 40%, IPE 10%, ÚFP 40%, MESING 10%                                | 31.07.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 40%, IPE 10%, ÚFP 40%, MESING 10%                          |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V11  | Gfunkt     | The compact vacuum chamber for ion trapping and quantum sensing  | ÚPT 60%, UPOL 30%, ÚFP 10%   | 31.12.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 60%, UPOL 30%, ÚFP 10%                                     |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V12  | Gfunkt     | The setup of the free space optical link for dissemination of optical frequencies over atmosphere            | ÚPT 20%, BUT SIX 70%, MESING 10%                                     | 31.12.2022 | 20.12.2022 | ÚPT 20%, BUT SIX 70%, MESING 10%                               |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V013 | Gfunkt     | Electronic system for locking the laser frequency on the mode of the optical resonator                       | ÚPT 70 %, BUT SIX 5 %, UPOL 10 %, UFE 5 %, ÚFP 5 %, MESING 5 %       | 31.12.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 70 %, BUT SIX 5 %, UPOL 10 %, UFE 5 %, ÚFP 5 %, MESING 5 % |
| DP13 | TN01000008/18 | TN01000008/18-V014 | Gfunkt     | Stabilization unit for free-space optical receiver   | ÚPT 20 %, VUT-SIX 70 %, MESING 10 %                                  | 31.12.2022 | 20.12.2022 | ÚPT 20 %, VUT-SIX 70 %, MESING 10 %                            |
| DP12 | TN01000008/19 | TN01000008/19-V1   | Gfunkt     | Functional sample of laser rangefinder   | MEOPTA 95%, BUT SIX 5%   | 31.12.2020 | 20.12.2020 | 95% MEOPTA, 5% BUT SIX   |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V1   | Gfunkt     | Cathodoluminescence Detector for the Life SciencesSector   | CRYTUR 100%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 100% Crytur  |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V2   | Ostatni    | Report on cathodoluminescence imaging possibilities of commercial fluorophore and cathodoluminescence p      | BC 35%, ÚPT 35%, CRYTUR 30%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 40% (Crytur), 40% (BC), 20% (UPT)                              |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V3   | Ostatni    | CL-SEM application in biological research  | BC 50%, ÚPT 25%, CRYTUR 25%  | 31.12.2020 | 06.11.2020 | 40% (Crytur), 40% (BC), 20% (UPT)                              |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V4   | Ostatni    | Methodical procedures for preparation and observation of various types of biological samples using a CL dete | BC 30%, ÚPT 20%, CRYTUR 50%  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | BC 30%, ÚPT 20%, CRYTUR 50%                                    |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V5   | Ostatni    | Research report  | BC 70%, ÚPT 30%  | 31.12.2022 | 04.08.2022 | BC 70%, ÚPT 30%  |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V006 | Gfunkt     | Adapter for sample transfer from HPF system to cryo-scanning electron microscopes                            | BC 40 %, ÚPT 50 %, CRYTUR 10 %                                       | 31.12.2022 | 31.12.2020 | BC 40 %, ÚPT 50 %, CRYTUR 10 %                                 |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V007 | Ostatni    | Research report  | BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %                                       | 31.12.2022 | 31.12.2020 | BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %                                 |
| DP28 | TN01000008/20 | TN01000008/20-V008 | Ostatni    | Research report  | BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %                                       | 31.12.2022 | 31.12.2020 | BC 40 %, UPT 30 %, CRYTUR 30 %                                 |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V1   | Gfunkt     | Pilot imaging optics for surface quality inspection  | ÚPT 70%, BUT CEITEC 10%, ÚFP 5%, MEOPTA 5%, MESING 10%               | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 80%, VUT-CEITEC 5%, ÚFP 5%, MESING 10%                     |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V2   | Gfunkt     | Laser source for ultra precise interferometry  | ÚPT 90%, BUT CEITEC 0%, ÚFP 0%, MEOPTA 10%, MESING 0%                | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 90%, MEOPTA 10%  |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V3   | Gfunkt     | Roughness measurement device for optical surfaces  | ÚPT 60%, BUT CEITEC 10%, ÚFP 10%, MEOPTA 10%, MESING 10%             | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 90%, MEOPTA 10%  |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V5   | Ostatni    | How levelling and scan line corrections ruin roughness measurement and how to prevent it                     | BUT CEITEC 100%  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | VUT-CEITEC 100%  |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V6   | Ostatni    | Radiation source with variable coherence for interferometry  | ÚPT 95%, MEOPTA 5%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | SI 95%, MEOPTA 5%  |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V7   | Ostatni    | Comparison of three focus sensors for optical topography measurement of rough surfaces                       | ÚPT 95%, MEOPTA 5%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | SI 95%, MEOPTA 5%  |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V4   | Ztech      | Technique for fusion of roughness data sets  | ÚPT 0%, BUT CEITEC 70%, ÚFP 10%, MEOPTA 10%, MESING 10%              | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT-CEITEC 80%, ÚFP 5%, MEOPTA 5%, MESING 10%                  |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V9   | Ztech      | Technique for combination of contact and non-contact data on optical elements                                | ÚPT 40%, BUT CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%                         | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%                   |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V8   | Gfunkt     | Large area non-contact topography measurement system for optical elements                                    | ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%                         | 31.12.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%                   |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V10  | Ztech      | Methodology for traceable form and roughness measurements on large optical surfaces                          | ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %                     | 31.12.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %               |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V011 | Gfunkt     | Large area non-contact topography measurement system for optical elements                                    | ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%                         | 31.12.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 40%, VUT-CEITEC 40%, ÚFP 10%, MESING 10%                   |
| DP10 | TN01000008/21 | TN01000008/21-V012 | Ztech      | Methodology for traceable form and roughness measurements on large optical surfaces                          | ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %                     | 31.12.2022 | 31.12.2020 | ÚPT 30 %, VUT-CEITEC 50 %, ÚFP 10 %, Mesing 10 %               |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V1   | Gfunkt     | New materials for scintillators  | ÚPT 0%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 100%                                   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | CRYTUR 100%  |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V3   | Ostatni    | Conference abstract  | ÚPT 80%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 20%                                   | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ÚPT 80%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 20%                             |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V4   | Ostatni    | Paper in proceedings   | ÚPT 70%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 30%                                   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 70%, VUT-CEITEC 0%, CRYTUR 30%                             |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V5   | Ostatni    | Final report   | ÚPT 60%, VUT-CEITEC 20%, CRYTUR 20%                                  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 60%, VUT-CEITEC 20%, CRYTUR 20%                            |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V6   | Ostatni    | Technical report   | ÚPT 10%, VUT-CEITEC 80%, CRYTUR 10%                                  | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 10%, VUT-CEITEC 80%, CRYTUR 10%                            |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V2   | Ztech      | Proven technology  | ÚPT 0%, BUT CEITEC 0%, CRYTUR 100%                                   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | CRYTUR 100%  |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V7   | Gfunkt     | Lithographic mask  | Crytur 100%  | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 100 % UPT  |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V8   | Gfunkt     | Specimen manipulator   | VUT 100%   | 31.12.2021 | 5.9.2021   | 100 % VUT  |
| DP29 | TN01000008/22 | TN01000008/22-V009 | Gfunkt     | ISI :: High-voltage power supply   | ÚPT 100 %  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 100 %  |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V4   | Fuzit      | Manipulator with micrometric sample positioning and spectrometer with this manipulator                       | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 08.09.2020 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V1   | Gfunkt     | Electrostatic column for 2D detection in UHV system (off-axis pixelated detector)                            | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 15.12.2020 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V2   | Ostatni    | Very low energy electron transmission spectroscopy of 2D materials   | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 07.08.2020 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V3   | Ostatni    | Study of electron scattering phenomena of advanced materials by UHV SLEEM/ToF                                | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 04.11.2020 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V5   | Gfunkt     | 2D detection system for reflected electrons in UHV SLEEM   | ÚPT 100%   | 31.12.2021 | 20.12.2021 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V6   | Ostatni    | article  | ÚPT 100%   | 31.12.2021 | 30.07.2021 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V7   | Gfunkt     | Manipulator with micrometric shift for a miniaturised secondary electron spectrometer                        | ÚPT 100%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V008 | R software | SW for control of electrostatic column equipped with hybrid pixelated detector                               | ÚPT 100%   | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V009 | Ostatni    | Study graphene by ToF spectroscopy   | ÚPT 100%   | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 100%   |
| DP22 | TN01000008/23 | TN01000008/23-V010 | Gfunkt     | Calibration standard sample for secondary electron spectroscopy in SEM                                       | ÚPT 100%   | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 100%   |
| DP21 | TN01000008/24 | TN01000008/24-V1   | Gfunkt     | The tool for correlation of cryo-SEM and cryo-Raman spectroscopy   | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 18.12.2020 | ÚPT 100%   |
| DP21 | TN01000008/24 | TN01000008/24-V2   | Ostatni    | The study of PHA producing microorganisms using a combination of cryo-SEM, TEM and Raman spectroscopy        | ÚPT 60%, BC 30%, UMCH 10%  | 31.12.2020 | 01.07.2020 | ÚPT 60%, BC 30%, UMCH 10%                                      |
| DP21 | TN01000008/24 | TN01000008/24-V3   | Ostatni    | conference contribution  | ÚPT 70%, BC 10%, UMCH 10%, TFS 10%                                   | 31.12.2020 | 05.09.2019 | ÚPT 70%, BC 10%, UMCH 10%, TFS 10%                             |
| DP21 | TN01000008/24 | TN01000008/24-V4   | Gfunkt     | A sample holder for FIB-SEM at low temperature   | ÚPT 100%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 100%   |
| DP21 | TN01000008/24 | TN01000008/24-V005 | Gfunkt     | Cryo-stage and anti-contaminator for FIB-SEM   | ÚPT 100 %  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 100 %  |
| DP21 | TN01000008/24 | TN01000008/24-V006 | Ostatni    | Conference contribution  | ÚPT 80 %, BC 20 %  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 80 %, BC 20 %  |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V1   | Gfunkt     | Pixelated detector for STEM in SEM   | TFS 100%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | TFS 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V2   | Gfunkt     | Pixelated detector for BSE detection in SEM  | TFS 100%   | 31.12.2020 | 31.12.2020 | TFS 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V4   | Ostatni    | Treatment and Observation of Advanced Carbon-Based Nanomaterials by Slow Electrons                           | ÚPT 100%   | 31.12.2020 | 01.09.2020 | ÚPT 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V3   | Ostatni    | Ultra low voltage STEM of 2D crystals  | ÚPT 100%   | 31.12.2019 | 31.12.2019 | ÚPT 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V5   | Gfunkt     | Tuneable pixelated detector for STEM in SEM  | TFS 100%   | 31.12.2021 | 31.12.2021 | TFS 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V6   | Ostatni    | 2D crystals study using pixelated STEM   | ÚPT 100%   | 31.12.2021 | 05.07.2021 | ÚPT 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V7   | Ostatni    | Advanced materials study using pixelated STEM  | ÚPT 100%   | 31.12.2021 | 24.12.2021 | ÚPT 100%   |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V008 | Ostatni    | Algorithm enabling automated data collection (report)  | TFS 100 %  | 31.12.2022 | 31.12.2022 | TFS 100 %  |
| DP15 | TN01000008/25 | TN01000008/25-V009 | Ostatni    | Advantages of new detector in materials science (Research abstract)  | ÚPT 100%   | 31.12.2022 | 31.12.2022 | ÚPT 100%   |
| DP19 | TN01000008/26 | TN01000008/26-V1   | Gfunkt     | Functional sample of temperature measurement.  | VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%                              | 31.12.2020 | 31.12.2020 | VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%                        |
| DP19 | TN01000008/26 | TN01000008/26-V2   | Gfunkt     | Functional sample of cryogenic manipulator.  | VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%                              | 31.12.2020 | 31.12.2020 | VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%                        |
| DP19 | TN01000008/26 | TN01000008/26-V3   | Ostatni    | Internal research report   | VUT-CEITEC 80%, TFS 0%, MUNI-CEITEC 20%                              | 31.12.2021 | 31.12.2021 | VUT-CEITEC 80%, TFS 0%, MUNI-CEITEC 20%                        |
| DP19 | TN01000008/26 | TN01000008/26-V4   | Gfunkt     | Functional sample of cathodoluminescence-based temperature detection scheme                                  | VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%                              | 31.12.2021 | 31.12.2021 | VUT-CEITEC 20%, TFS 80%, MUNI-CEITEC 0%                        |

|      |               |                    |         |  |                               |            |            |                           |
|------|---------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| DP19 | TN01000008/26 | TN01000008/26-V005 | Gfunk   | Cathodoluminescence-based narrow-band temperature detection scheme with gain equilibration routine                 | VUT-CEITEC 20 %, TFS 80 %     | 31.12.2022 |            | VUT-CEITEC 20 %, TFS 80 % |
| DP18 | TN01000008/27 | TN01000008/27-V2   | Gfunk   | Specimen insert/retract mechanism proof of concept   | TFS 90%, BUT-CEITEC: 10%      | 31.12.2020 | 31.03.2020 | TFS 95 %, VUT 5 %         |
| DP18 | TN01000008/27 | TN01000008/27-V1   | Gfunk   | Sample holder reduction  | TFS 100%                      | 31.12.2020 | 31.05.2020 | TFS 100%                  |
| DP18 | TN01000008/27 | TN01000008/27-V3   | Gfunk   | Specimen holder reducing vibrations  | TFS 95%, VUT 5%               | 31.12.2021 | 10.12.2021 | TFS 95%, VUT 5%           |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V2   | Ostatni | CryoStage Concept Study  | TFS 50%, ÚPT: 50%             | 30.09.2020 | 30.09.2020 | TFS 50%, ISI: 50%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V3   | Gfunk   | Proof of Concept   | TFS 50%, ÚPT: 50%             | 31.12.2020 | 31.12.2020 | TFS 50%, ISI: 50%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V4   | Ostatni | Design study document  | TFS 40%, ÚPT: 60%             | 31.12.2020 | 31.12.2020 | TFS 40%, ISI: 60%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V1   | Ostatni | Literature review  | TFS 0%, ÚPT: 100%             | 30.11.2019 | 30.11.2019 | TFS 0%, ÚPT: 100%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V5   | Gfunk   | LN2 Dewar with cold-finger to CryoStage - functional sample v2   | TFS 50%, ÚPT: 50%             | 30.06.2021 | 30.06.2021 | TFS 50%, ÚPT: 50%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V6   | Ostatni | CryoStage thermal experiments and thermal model validations - report   | TFS 50%, ÚPT: 50%             | 30.06.2021 | 30.06.2021 | TFS 50%, ÚPT: 50%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V7   | Ostatni | Study of low temperature thermal resistances and their quality for the better modelling and calculation of coolers | TFS 50%, ÚPT: 50%             | 31.12.2021 | 23.12.2021 | TFS 50%, ÚPT: 50%         |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V008 | Ostatni | Feasibility study for LN2 cooled CryoStage enabling both temperature states of the specimen holder                 | TFS 50 %, ÚPT 50 %            | 31.12.2022 |            | TFS 50 %, ÚPT 50 %        |
| DP20 | TN01000008/28 | TN01000008/28-V009 | Gfunk   | Functional sample for Proof of principle for new Cryostage enabling both temperature state of specimen holder      | TFS 50 %, ÚPT 50 %            | 31.12.2022 |            | TFS 50 %, ÚPT 50 %        |
| DP26 | TN01000008/29 | TN01000008/29-V1   | Gfunk   | Robust method for preparation self-blotting nanowire TEM grids   | MUNI-CEITEC 60%,VUT-CEITEC20% | 31.12.2020 | 18.12.2020 | MUNI-CEITEC 100%          |
| DP26 | TN01000008/29 | TN01000008/29-V2   | Ostatni | Protocol for reproducible preparation of CuOH nanowires on TEM grids   | MUNI-CEITEC 75%,VUT-CEITEC25% | 31.12.2022 | 31.12.2021 | MUNI-CEITEC 100%          |
| DP26 | TN01000008/29 | TN01000008/29-V3   | Ostatni | Spin wave propagation in corrugated waveguides   | MUNI-CEITEC 25%,VUT-CEITEC75% | 31.12.2021 | 31.12.2021 | MUNI-CEITEC 0%            |
| DP31 | TN01000008/30 | TN01000008/30-V1   | Gfunk   | Specimen holder for the electron induced cleaning in SEM   | ÚPT 90%, TFS 10%              | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ÚPT 90%, TFS 10%          |
| DP31 | TN01000008/30 | TN01000008/30-V2   | Ostatni | Methods of the electron induced cleaning in SEM  | ÚPT 50%, TFS 50%              | 31.12.2021 | 30.07.2021 | ÚPT 50%, TFS 50%          |
| DP31 | TN01000008/30 | TN01000008/30-V003 | Ostatni | Contamination mitigation strategy for SEMs   | ÚPT 70 %, TFS 30 %            | 31.12.2022 |            | ÚPT 70 %, TFS 30 %        |
| DP32 | TN01000008/31 | TN01000008/31-V1   | Ostatni | Simulation of gas flow and sample temperature distribution in the micro-reactor device                             | ÚPT 50%, TFS 50%              | 31.12.2021 | 31.12.2021 | ÚPT 50%, TFS 50%          |
| DP32 | TN01000008/31 | TN01000008/31-V002 | Ostatni | Mathematical-physical analysis of thermodynamic conditions in the micro-reactor II.                                |                               | 31.12.2022 |            | ÚPT 50%, TFS 50%          |